日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて うる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed ith this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年10月30日

出 願 番 号 Application Number: 特願2003-370326

[ST. 10/C]:

[JP2003-370326]

願 pplicant(s):

TDK株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月 5日





出証番号 出証特2004-3007130

.【書類名】 特許願 【整理番号】 99P06279 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 H03H 9/17 【発明者】 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【氏名】 小室 栄樹 【発明者】 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【氏名】 永塚 敏行 【発明者】 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【氏名】 安井 勉 【特許出願人】 【識別番号】 000003067 【氏名又は名称】 TDK株式会社 【代理人】 【識別番号】 100101971 【弁理士】 【氏名又は名称】 大畑 敏朗 【選任した代理人】 【識別番号】 100098279 【弁理士】

【氏名又は名称】 【手数料の表示】

> 【予納台帳番号】 080736 【納付金額】 21,000円

栗原 聖

【提出物件の目録】

【物件名】特許請求の範囲 1【物件名】明細書 1【物件名】図面 1【物件名】要約書 1



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

素子基板上に形成されて圧電膜の内部を伝搬するバルク波により所定の共振周波数の信号 を得る圧電共振器と、

前記圧電共振器がN個の電気接合突起部を介してフェースダウンボンディングにより実装された実装基板とを有し、

前記圧電共振器が前記実装基板に実装された状態における前記電気接合突起部の最大直径を $D(\mu m)$ としたとき、ダイシェア強度がND/6(g)以上であることを特徴とする電子部品。

【請求項2】

素子基板上に形成されて圧電膜の内部を伝搬するバルク波により所定の共振周波数の信号 を得る圧電共振器と、

前記圧電共振器がN個の電気接合突起部を介してフェースダウンボンディングにより実装された実装基板とを有し、

前記圧電共振器が前記実装基板に実装された状態における前記電気接合突起部の最大直径を $D(\mu m)$ としたとき、ダイシェア強度がND/3. 6(g)以上であることを特徴とする電子部品。

【請求項3】

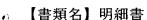
前記電気接合突起部は金で形成されていることを特徴とする請求項1または2記載の電子 部品。

【請求項4】

前記圧電共振器は、SMR型の圧電共振器であることを特徴とする請求項1~3の何れか一項に記載の電子部品。

【請求項5】

前記圧電共振器は、前記素子基板と前記圧電膜との間に音響多層膜を有することを特徴と する請求項4記載の電子部品。



【発明の名称】電子部品

【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は電子部品に関し、特に圧電膜内を伝搬するバルク波を利用した圧電共振器が用いられた電子部品に関するものである。

【背景技術】

[00002]

たとえば携帯型の無線通信機において送信信号と受信信号とを分配するデュプレクサには、小型化に有利な圧電共振器が用いられている。

[0003]

従来における圧電共振器を用いたデュプレクサでは、送信側フィルタと受信側フィルタとをそれぞれワンパッケージ化し、これを電気回路基板用のパッケージに収めてデュプレクサとしているため、小型化の利点が十分に生かし切れずにサイズが大きくなる。

[0004]

ここで、小型化を図るために、ワイヤボンディングに替えてバンプ(電気接合突起部)を用いたフリップチップによるフェースダウンボンディングで圧電共振器を実装することが考えられる。フリップチップでは、チップ面積内でパッケージとの電気的接続が可能なために二次元スペースが効率化できるとともに、ループを描くためにある程度の高さが必要とされるワイヤを用いないために低背化も可能になるからである。

[0005]

圧電共振器をフリップチップで実装基板に実装する技術は、たとえば特開2002-23253号公報や特開平10-270979号公報に、また、2個の圧電共振器をフリップチップで実装基板に実装してデュプレクサを形成する技術は、たとえば特開平11-88111号公報や特開2003-179518号公報に、それぞれ開示されている。

【特許文献1】特開2002-232253号公報

【特許文献2】特開平10-270979号公報

【特許文献3】特開平11-88111号公報

【特許文献4】特開2003-179518号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、前述した特許文献においては、何れもシェア強度、特にダイシェア強度 に関しては言及されていない。

[0007]

ダイシェア強度は、実装基板に電気接合突起部を介してボンディングされたICチップ (ここでは、圧電共振器)をシェアツールで横から水平方向に押し、チップと実装基板と の接合部分またはチップが破断されたときの荷重値をいい、このダイシェア強度がある程 度以上でなければ、衝撃に対する信頼性が低下することになる。

[0008]

そして、ダイシェア強度と密接に関係しているバンプの数や径は圧電共振器により区々であることから、信頼性を確保するにはどの程度のダイシェア強度があればよいかを規定するのは困難であった。

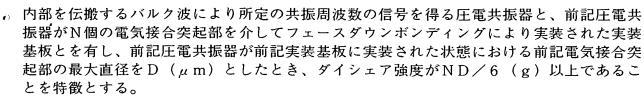
[0009]

そこで、本発明は、フェースダウンボンディングにより圧電共振器が実装された電子部品において必要なダイシェア強度を確保することのできる技術を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

$[0\ 0\ 1\ 0]$

上記課題を解決するため、本発明に係る電子部品は、素子基板上に形成されて圧電膜の



$[0\ 0\ 1\ 1]$

また、上記課題を解決するため、本発明に係る電子部品は、素子基板上に形成されて圧電膜の内部を伝搬するバルク波により所定の共振周波数の信号を得る圧電共振器と、前記圧電共振器がN個の電気接合突起部を介してフェースダウンボンディングにより実装された実装基板とを有し、前記圧電共振器が前記実装基板に実装された状態における前記電気接合突起部の最大直径をD(μ m)としたとき、ダイシェア強度がND/3.6(g)以上であることを有することを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

本発明の好ましい形態において、前記電気接合突起部は金で形成されていることを特徴とする。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

本発明のさらに好ましい形態において、前記圧電共振器はSMR型の圧電共振器であることを特徴とする。

[0014]

本発明のさらに好ましい形態において、前記圧電共振器は前記素子基板と前記圧電膜と の間に音響多層膜を有することを特徴とする。

【発明の効果】

$[0\ 0\ 1\ 5]$

本発明によれば以下の効果を奏することができる。

[0016]

すなわち、ダイシェア強度をND/6(g)以上、望ましくはND/3. 6(g)以上とすることにより、必要なダイシェア強度を確保することが可能になる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照しつつさらに具体的に説明する。ここで、添付図面において同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した説明は省略されている。なお、ここでの説明は本発明が実施される最良の形態であることから、本発明は当該形態に限定されるものではない。

[0018]

図1は本発明の一形態における電子部品に用いられた圧電共振器を示す断面図、図2は本発明の一形態である電子部品を示す断面図、図3は本発明の電子部品を構成する圧電共振器に形成されたバンプであり、(a)はバンプ形成直後で実装前の状態を、(b)はフリップチップ実装された後の状態をそれぞれ示す説明図である。

[0019]

図1に示す圧電共振器10はSMR(Solidly Mounted Resonator)型圧電共振器と呼ばれるもので、たとえば単結晶シリコンからなる素子基板11の上に、音響インピーダンスが高い薄膜と低い薄膜、たとえばAlN膜12aとSiO2膜12bとが交互に各4層ずつ形成されてなる音響反射膜12が形成されている。この音響反射膜12上には密着層13としてのAlN膜を介してPt膜が真空蒸着法により成膜され、リソグラフィーによりパターニングされて下部電極14が形成されている。

[0020]

さらに、下部電極14上には、スパッタリング法により2nOからなる圧電膜15が成膜されている。そして、圧電膜15上には、同じく密着層16としてのCr膜を介してスパッタリング法によりAIが成膜され、リソグラフィーによりパターニングされて上部電極17が形成されている。なお、圧電膜15の膜厚は通常10μm以下であり、素子基板

11を用いずに圧電共振器10を作製することは困難である。また、圧電膜15には、下部電極14を露出させるために、エッチング等により孔を設けてもよい。

[0021]

このような圧電共振器 10は、下部電極 14と上部電極 17とにスタッドバンプやメッキバンプなどのバンプ(電気接合突起部) 18(図 2、図 3)が形成される。そして、後述する実装基板 19に実装して下部電極 14と上部電極 17とに交流電圧を印加すると、圧電効果により圧電膜 15の内部を伝搬するバルク波により所定の共振周波数の信号が得られる。

[0022]

なお、音響反射膜12は形成されていなくてもよく、この場合には素子基板11上に直接下部電極14が形成される。また、本形態においては音響反射膜12は4層であるが、音響インピーダンスの異なる薄膜が積層されていれば、4層に限らない。さらに、各薄膜の膜質は上記のものに限定されるものではなく、一例に過ぎない。そして、バンプ18には、はんだ、金、アルミニウム、銅などを適用することができる。

[0023]

図2に示すように、圧電共振器10はバンプ18を介してフェースダウンボンディングにより実装基板19に実装される。実装基板19の外周部分には環状のスペーサ20が固定されており、このスペーサ20に蓋(封止部材)21が固定されることで圧電共振器10が封止されて電子部品22が構成されている。なお、図示する場合には、実装基板19と蓋21とはスペーサ20を介して固定されているが、実装基板19の外周が立ち上がった形状にすることにより、あるいは蓋21をキャップ状にすることにより、実装基板19と蓋21とを直接固定するようにしてもよい。

[0024]

なお、バンプが接合される実装基板 19 側の電極については、例えば電極にCuが使用されている場合、そのままではバンプを形成した圧電共振器 10 を接合することはできない。すなわち、電極であるCu の上にNi ($3 \sim 5 \mu m$)を、さらにその上にAu (30 0 Å以上)を成膜する必要がある。その際、プラズマ処理を行う必要もある。実装基板 1 9 としてセラミック基板(たとえばLTCC:Low Temperature Cofired Ceramic:低温焼成セラミック)を用いる際も同様に、Ag電極上にNi ($3 \sim 5 \mu m$)を、さらにその上にAu (300 Å以上)を成膜する必要がある。

[0025]

ここで、本発明者は、圧電共振器 1 0 が 8 個のバンプを介してフェースダウンボンディングにより実装基板 1 9 に実装された電子部品 2 2 を作成した。そして、このような電子部品 2 2 におけるシェア強度について検討を行った。

[0026]

シェア強度とは、圧電共振器 1 0 上に作製された 1 つのバンプ 1 8 をシェアツールで横から水平方向に押し、バンプ 1 8 が接合面で破断されたときの荷重値をいう。一方、ダイシェア強度とは、実装基板 1 9 にバンプ 1 8 を介してボンディングされた圧電共振器 1 0 をシェアツールで横から水平方向に押し、圧電共振器 1 0 と実装基板 1 9 との接合面が破断されたときの荷重値をいい、全バンプについてとらえて圧電共振器 1 0 における実装基板 1 9 に対する接合強度でとらえたものである。したがって、ダイシェア強度は、多少の誤差はあるものの、(バンプ 1 個のシェア強度)×(バンプの個数)、で算出できることから、本明細書では、これに従っている。

[0027]

なお、バンプのシェア強度は、バンプを圧電共振器 10 であるダイ (チップ) に押し付けて固定する際の荷重、超音波出力、超音波印加時間およびダイの表面状態 (プラズマ処理の有無)により、変えることができる。

[0028]

バンプ径およびシェア強度とヒートサイクル試験の結果について表1に示す。



サンプルグ ループ番号	バンプ径 R (μm)	シェア強度 (g)	バンプ径 D (μm)	ダイシェア 強度 (g)	ヒートサイクル 試験結果
1	100	20 (R/5)	120	160	結果1(約1%)
2	100	33 (R/3)	120	264	結果2
3	60	12 (R/5)	72	96	結果1(約3%)
4	60	20 (R/3)	72	160	結果2
5	80	16 (R/5)	96	128	結果1(約2%)
6	80	27 (R/3)	96	216	結果 2
7	120	24 (R/5)	144	192	結果1(約2%)
8	120	40 (R/3)	144	320	結果 2
9	150	30 (R/5)	180	240	結果1(約1%)
10	150	50 (R/3)	180	400	結果 2
11	150	22 (R/7)	180	176	結果 3
12	120	20 (R/6)	144	160	結果 3
13	80	24 (R/3.3)	96	192	結果1(約0.3%)
14	120	35 (R/3.4)	144	303	結果1(約0.2%)
15	80	14 (R/5.7)	96	118	結果 3
16	100	18 (R/5.5)	120	152	結果 3

[0029]

ここで、サンプルグループとは、相互に同一のバンプ径、シェア強度を有する複数個の サンプルで形成されたグループをいう。

[0030]

また、バンプ径Rとは、バンプを圧電共振器10に形成した直後で実装前の状態における最大直径をいい、バンプ径Dとは、フリップチップ実装された後の状態における最大直径をいう。これは、図3に示すように、実装前のバンプ(図3(a))の最大直径をRとすると、フリップチップ接合する際にバンプには一定方向に超音波がかけられるために押しつぶされるように変形し、実装後のバンプ(図3(b))の最大直径Dは、実装前のバンプの最大直径Rに対して最大15~20%大きくなる。そこで、実装前後のバンプ径を区別するために、このような2種類の最大直径を用いた。変形後の2次元形状は、通常は長円あるいは楕円となる。なお、バンプ径は2次元投影形状で測定した。

[0031]

さらに、シェア強度の項目における括弧内は、シェア強度とバンプ径Rとの関係を表している。

[0032]

そして、ヒートサイクル試験結果の項目において、結果1とは、-40℃~85℃のヒートサイクル試験(各30分)で、100時間経過後において問題が発生しなかったが、100~200時間の間に少なくとも1個のバンプにクラックが入っているサンプルが所定パーセント確認されたとの試験結果をいう。なお、当該項目の括弧内の数値が、バンプ

にクラックが入っているサンプルの発生割合を表している。

[0033]

結果2とは、-40 \mathbb{C} ~ 85 \mathbb{C} のヒートサイクル試験(各30分)で、200時間経過後において問題が発生しなかったとの試験結果をいう。結果3とは、-40 \mathbb{C} ~ 85 \mathbb{C} のヒートサイクル試験(各30分)で、50時間以内に10%以上のサンプルで8個のバンプのうち最低1個にクラックが確認されたとの試験結果をいう。

[0034]

表1に示すように、サンプルグループ番号1、3、5、7、9、13、14では結果1が、サンプルグループ番号2、4、6、8、10では結果2が、そして、サンプルグループ番号11、12、15、16では結果3が、それぞれ得られた。

[0035]

ここで、バンプ数をNとした場合、バンプ数、バンプ径D、ダイシェア強度の関係について規定を行った。すると、結果1では(ダイシェア強度)=ND/6(g)、ND/4(g)、ND/3. 8(g)、結果2では(ダイシェア強度)=ND/3. 6(g)、そして、結果3では(ダイシェア強度)=ND/8. 18(g)、ND/7. 2(g)、ND/6. 3(g)、となっていることが分かった。

[0036]

これらより、ダイシェア強度がND/6(g)以上であれば結果1が、ND/3. 6(g)以上であれば結果2が得られると考察される。そして、良好な結果は結果1、一層良好な結果は結果2であるから、ダイシェア強度をND/6(g)以上、望ましくはND/3. 6(g)以上とすることにより、必要なダイシェア強度を確保することが可能になる

【産業上の利用可能性】

[0037]

以上の説明においては、本発明をSMR型の圧電共振器に適用した場合について説明したが、上下電極に挟まれた圧電膜の上下方向を大気開放の状態にし、音響的に全反射させるダイヤフラム型および空隙型の圧電共振器など、圧電膜を用いた積層型の圧電共振器全般に適用することができる。但し、ダイヤフラム型の圧電共振器では、素子基板が撓んだり、超音波接合の際にクラックが入る等のおそれがあるが、SMR型の圧電共振器ではそのようなおそれはないので、SMR型の圧電共振器に適用するのが望ましい。

[0038]

また、図2に示す電子部品では、圧電共振器が1個実装されているが、本発明は、例えば一方を送信側フィルタ、他方を受信側フィルタとしたデュプレクサなど、圧電共振器が複数個実装された電子部品に適用することもできる。

【図面の簡単な説明】

[0039]

- 【図1】本発明の一形態における電子部品に用いられた圧電共振器を示す断面図である。
- 【図2】本発明の一形態である電子部品を示す断面図である。
- 【図3】本発明の電子部品を構成する圧電共振器に形成されたバンプについて、(a)はバンプ形成直後で実装前の状態を、(b)はフリップチップ実装された後の状態をそれぞれ示す説明図である。

【符号の説明】

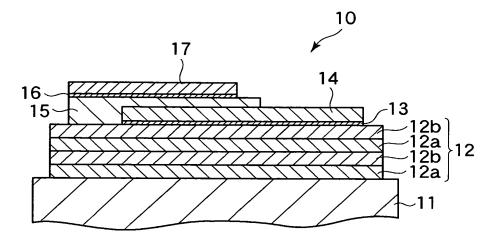
[0040]

- 10 圧電共振器
- 11 素子基板
- 12 音響反射膜
- 12a AlN膜
- 12b SiO2膜
- 13 密着層

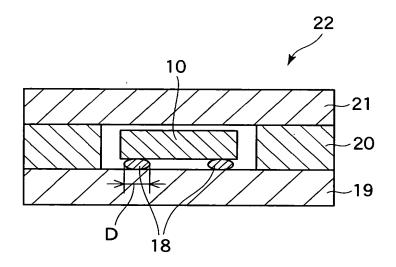
- 14 下部電極 15 圧電膜

 - 1 6 密着層
 - 上部電極 1 7
 - バンプ (電気接合突起部) 1 8
 - 1 9 実装基板
 - 2 0 スペーサ
 - 2 1 蓋(封止部材)
 - 2 2 電子部品

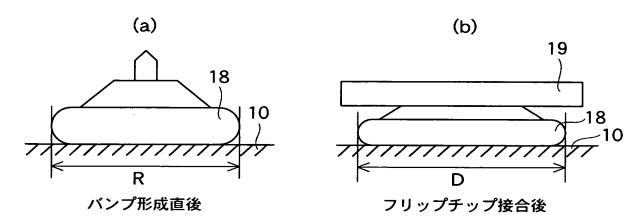
【書類名】図面 【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 フェースダウンボンディングにより圧電共振器が実装された電子部品において 必要なダイシェア強度を確保する。

【解決手段】 素子基板11に形成されて圧電膜15の内部を伝搬するバルク波により所定の共振周波数の信号を得る圧電共振器10と、圧電共振器10がN個のバンプ18を介してフェースダウンボンディングにより実装された実装基板19とを有する電子部品22において、圧電共振器10が実装基板19に実装された状態におけるバンプ18の最大直径E0 (μ m) としたとき、ダイシェア強度をND/E6 (E9)以上、望ましくはND/E3. E9 以上とする。

【選択図】

図 3

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-370326

受付番号 50301801137

書類名 特許願

担当官 第七担当上席 0096

作成日 平成15年10月31日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年10月30日

特願2003-370326

出願人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日

2003年 6月27日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 TDK株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.